

# 装置と場所の対応表 Equipment and Location Correspondence Table

## 共通機器センター Shared Research Facilities

番号 Number	場所 Place	居室 Room	一般名 Common name	装置名 Equipment name		
1	豊洲校舎 Toyosu campus	テクノプラザ	X線回折装置 XRD	Ultima IV (Rigaku)		
2		テクノプラザ	X-ray Diffractometer	SmartLab (Rigaku)		
3		テクノプラザ	走査型電子顕微鏡 SEM	汎用SEM 6010LV (JEOL)		
4		テクノプラザ5(01I32室)	Scanning Electron Microscope	新分析SEM with EDS (JEOL/JSM-IT510LV)		
5		テクノプラザ	電界放出型走査電子顕微鏡 FE-SEM	FE-SEM JSM-7610 (JEOL)		
6		テクノプラザ	Field Emission-type SEM	FE-SEM JSM-7100 (JEOL)		
7		テクノプラザ2*	電子線マイクロアナライザ EPMA	Electron Probe Micro Analyzer	EPMA-8050G (Shimadzu)	
8		テクノプラザ	熱重量示差熱分析装置 TG-DTA	Thermal Analysis	TG-DTA2020SA (BRUKER AXS)	
9			精密熱重量ガス分析装置 TG-MS	Thermogravimetry Mass Spectrometer	TG5500 SI (テイ・エイ・インストルメント) & GSD350 (PIFFER VACUUM) 注: 600°C以上を測定する場合、各研究室で測定物質に適合する専用パン(皿)9.1~12.2万円(3個入り)を購入する必要があります	
10			レーザー顕微鏡	Laser Microscope	OLS4000 (Olympus)-1	
11					OLS4000 (Olympus)-2	
12			デジタルマイクロスコープ	Digital Microscope	VH-Z100UR (KEYENCE)	
13			プローブ顕微鏡	Probe Microscope	汎用AFM AFM5000 II (HITACHI)	
14					高機能AFM SPM8000-FM (Shimadzu)	
15			光学顕微鏡	Optical Microscope	BX51 (Olympus)	
16			引張圧縮試験機	Mechanical Testing Machine	AG-50kNX (Shimadzu)	
17			ゼータ電位・ナノ粒子径測定システム	Zeta-Potential and Nano-Particle-size Analyzer	DelsaMax PRO (BECKMAN COUNTER)	
18			テクノプラザ2*	顕微ラマン分光装置	Laser Raman spectrometry	LabRAM HR Evolution (HORIBA)
19			分析解析センター3 12F30	分光エリプソメータ	Spectroscopic Ellipsometer	RC2-DI-SUY (J.A.Woollam社 ジェー・イー・ウーラム・ジャパン)
20			テクノプラザ	フーリエ変換赤外分光光度計 FT-IR	Fourier Infrared Spectrometer	IRAffinity-1S (Shimadzu)
21				顕微フーリエ変換赤外分光光度計 FT-IR	Fourier Infrared Spectrometer	FT-IR-4X + IRT-5200 (Jasco)
22				紫外可視分光光度計	UV-Vis Spectrophotometer	V630-BIO (Jasco)
23				テラヘルツ分光光度計	Terahertz Spectrophotometer	VIR-F (Jasco)
24				紫外可視赤外分光光度計	UV-Vis-NIR Spectrophotometer	UV-3600 Plus (Shimadzu)
25		分析解析センター3 12F30		分光蛍光光度計	Spectrofluoro-Photometer	FP-750 (Jasco)
26		テクノプラザ	X線CTスキャン	X-ray CT Scan	μ Ray8700 (Matsusada)	
27		テクノプラザ2*	スパッタリング装置	Sputtering Equipment	CFS-4ES II (SHIBAURA MECHATRONICS)	
28		テクノプラザ	サーマルマネキン	Thermal mannequin	TM8-22R (PT-Teknik)	
29		分析解析センター3 12F30	自動接触角測定装置	Contact angle measuring device	OCA15EC (Dataphysics Instruments GmbH)	
30			窒素吸着比表面積細孔分布測定装置	Adsorption Measurement	Belsorp II mini (MicrotracBEL Corp.)	
31		09I25 クリーンルーム	マスクレス露光装置	Maskless Lithography System	DL-1000GS/SS (NanoSystem, 9Fクリーンルーム)	
32		分析解析センター3 12F30	偏光ゼーマン原子吸収分光光度計	Polarized Zeeman atomic absorption spectrophotometer	Z-2300 (HITACHI)	
33			質量分析計	Mass Spectrometer	AXIMA-CFR+(plus) (SHIMADZU)	
34		13G27-b	大気圧イオン化高分解能飛行時間型質量分析計	Mass Spectrometer	JMS-T100LP (JEOL)	
35		分析解析センター3 12F30	円二色性分散計	Circular dichroism spectrometer	J-820 (JASCO)	
36		分析解析センター2 11B27	核磁気共鳴装置	Nuclear Magnetic Resonance, NMR	JNM-ECZL400R (JEOL)	
37		テクノプラザ2*	真空加熱蒸着装置	Vacuum Evaporation System	SVC-700T (SANYU ELECTRON)	
38			電子ビーム蒸着装置	Electron Beam Evaporation System	SVC-700LEB (SANYU ELECTRON)	
39			シリコン深掘り装置 (Deep RIE)	Silicon Deep Reactive Ion Etching Machine	MUC21 ASE-SRE (SPP technologies)	
40			2次元印刷装置 (フードプリンター)	Food Printer	MMP-F13S (Mastermind)	
41			プラズマ微細加工装置	Plasma microfabrication equipment	TEP-01x (立山マシン株式会社)	
42			その他MEMS関連装置群 (スピンドクター、ホットプレート、乾燥器等 Spin Coater etc. for MEMS)		-	
43			小型無冷媒型 PPMS		VersaLab TM (Quantum Design)	
44			半導体パラメータアナライザ		4156B (Hewlett packard)	

45	テクノプラザ	手動回転研磨機 Rotary Polishing Machine	LaboPol-30 (Struers)	
46		アクティブラーニングスペース Active Learning Space	打ち合わせスペース Meeting space	
47		テクノ工房 Techno Studio		
48		低速切断機アイソメット Low speed cutting machine	Isomet (Buehler)	
49		恒温振とう培養器 Homeothermic shaking incubator	BR-11FP (タイテック)	
50		小型電気炉 Small electric furnace	HPM-1N (As one)	
51		小型熱プレス機 Small heat press machine	AH-2003 (As one)	
52		テクノプラザ4	レーザー加工機 大型(A1サイズまで) Laser cutting machine	Speedy400 (Trotec Laser) 100W
53			レーザー加工機 小型(A3サイズまで) Laser cutting machine	Rayjet 50 (Trotec Laser)
54			樹脂用簡易CNC切削機 MODEL A model MDX-40 (ローランド ディー・ジー)	
55	熱溶融積層型3Dプリンタ Fused Deposition Modeling 3D Printer		Ender 3 S1 Pro (Creality)	
56	101-2	電界放出型走査電子顕微鏡 FE-SEM(Field Emission-type SEM)	JSM-7400F(JEOL)	
57		透過型電子顕微鏡TEM TEM(Transmission Electron Microscope)	JEM-2100(JEOL)	
58	202	(新)集束イオンビーム加工装置 FIB(Focused Ion Beam)	MI-4050(日立ハイテク)	
59		(旧)集束イオンビーム加工装置 FIB(Focused Ion Beam)	FB-2000A(日立ハイテクノロジー)	
60		X線回折装置 XRD(X-ray Diffractometer)	SmartLab (Rigaku) Rintの置き換えです	
61		単結晶X線構造解析装置 Single-Crystal Xray Diffraction	D8 QUEST(ブルカー・ジャパン)	
62		レーザー顕微鏡 Laser Microscope	OLS-1100(オリンパス)	
63		窒素水蒸気吸着比表面積測定装置 Adsorption Measurement	Belsorp MaxII (MicrotracBEL Corp.)	
64		真空蒸着装置 Vacuum Evaporation System	JEE-400(JEOL)	
65		ウルトラミクロトーム Ultra microtome	EM-ULTRACUT UCT(ライカ)	
66		精密研磨装置 Polisher	ダイヤラップML-150P(マルトー)	
67		マニュアルプローバー Manual prober	705B(日本マイクロニクス)	
68		ピコ秒蛍光寿命測定装置 C11200(浜松ホトニクス)		
69		絶対PL量子収率測定装置 C9920-02G(浜松ホトニクス)		
70		101-1	超純水製造装置 Ultrapure water production equipment	Direct-Q UV(ミリポア)
71			光学顕微鏡 Optical microscope	LV100D-U(ニコン)
72			ナノインプリント装置 Nanoimprint equipment	LTNIP-5000(リソテック)
73			超臨界乾燥装置 Supercritical dryer	SCRD4(レクザム)
74			熱処理装置 Heat treatment equipment	GFA430VN(サーモ理工)
75	無電解メッキ装置 Electroless metal plating equipment		* (山本鍍金試験器)	
76	スピンコーター Spin coater		ACT-300A II (アクティブ)	
77	膜厚計測装置 Film thickness measuring device		FE-300(大塚電子)	
78	超音波ホモジナイザー Ultrasonic homogenizer		UP-50H(ヒールツィシャー)	
79	104		プロトンビームライター PBW(Proton Beam Writer)	MBS-1000(神戸製鋼所)
80	105	超伝導量子干渉磁束計 SQUID Superconducting quantum interference device	MPMS-XL(日本カンタムデザイン)	
81	107	核磁気共鳴装置 NMR(Nuclear Magnetic Resonance)	JNM-ECZL400R(JEOL)	
82	301	LC-MS(高速液体クロマトグラフィー-QTRAP 型質量分析装置) Liquid chromatography mass spectrometer	QTRAP® 5500 LC-MS/MS(AB Sciex Pte. Ltd.)	
83	301	セルソーター(フローサイトメーター) Cell Sorter	BD FACSAria III (日本ベクトン・ディッキンソン)	
84	303	放電プラズマ焼結(SPS)装置 Spark plasma sintering equipment	LABOX-210(シンターランド)	

\*テクノプラザ2とは、交流棟1階 テクノプラザ3室隣の部屋です。  
Technoplaza 2 is located next to Technoplaza 3 on the first floor of Kouryu-building.

### ものづくりセンター Manufacturing Center

番号 Number	場所 Place	居室 Room	一般名 Common name	装置名 Equipment name
85			立形マシニングセンタ Vertical Machining Center	MB-46VA (オークマ)
86			射出成形機 Injection Molding Machine	NPX7-1F(日精樹脂工業株)
87			バンドソー、コンターマシン Contour machine	NCC-300LE(ニコテック)

88	豊洲校舎 Toyosu campus	テクノプラザ3	ファインカッター高速切断機 High-speed cutting machine	HS45A型Cタイプ(平和テクニカ)
89			CNCワイヤー放電加工機 CNC wire electric discharge machine	VL400Q(ソディック)
90			卓上フライス盤 Bench type milling machine	YS300MT(東和精機)
91			卓上旋盤 Bench lathe	YS550V(東和精機)
92			積層造形機 Additive manufacturing machine	M3DS-100(ファソテック)
93			油圧プレス(5t) Hydraulic press	HYP-505H(JAM)
94			ビッカース硬さ試験機 Hardness testing machine	アカシ(ミットヨ)
95			オートグラフ Universal testing machine	AG-20KNG(島津製作所)
96			ベンチグラインダー Bench grinder	FG255T(YODOGAWA)
97			圧入機 Press fitting machine	渡辺機械
98			バンドソー Band Saw	K-100(ホーザン)
99	ボール盤 Drilling machine	TB131(マキタ) DP3050R(REXON)		
100	大宮校舎 Omiya campus	4号館4102室	マシニングセンタ	V33i(MAKINO)
101			ターニングセンタ	LB3000EX II(okuma)
102			芝ミル(樹脂&低負荷金属用早工CNCフライス)	向島テック
103			フライス盤	AM103(DMG MORI)
104			フライス盤	NK-1R(IWASHITA)
105			旋盤	MATE-570S(ヤマザキマザック)
106			帯鋸盤	CRA-300(AMADA)
107			コンタマシン	U-500(LUXO)
108			ボール盤	ESD-460(遠州工業)
109			卓上旋盤	L5200型S(コスモキカイ)
110	卓上フライス盤	FK-500S(コスモキカイ)		
111	卓上ボール盤	大西機械設計		
112	バンドソー	BS23(東洋アソシエイツ)		
113	ベルトグラインダー	BGM-50(日立工機)		